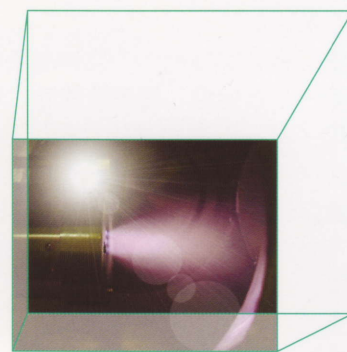
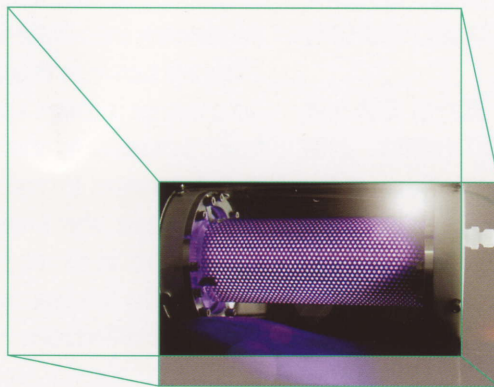


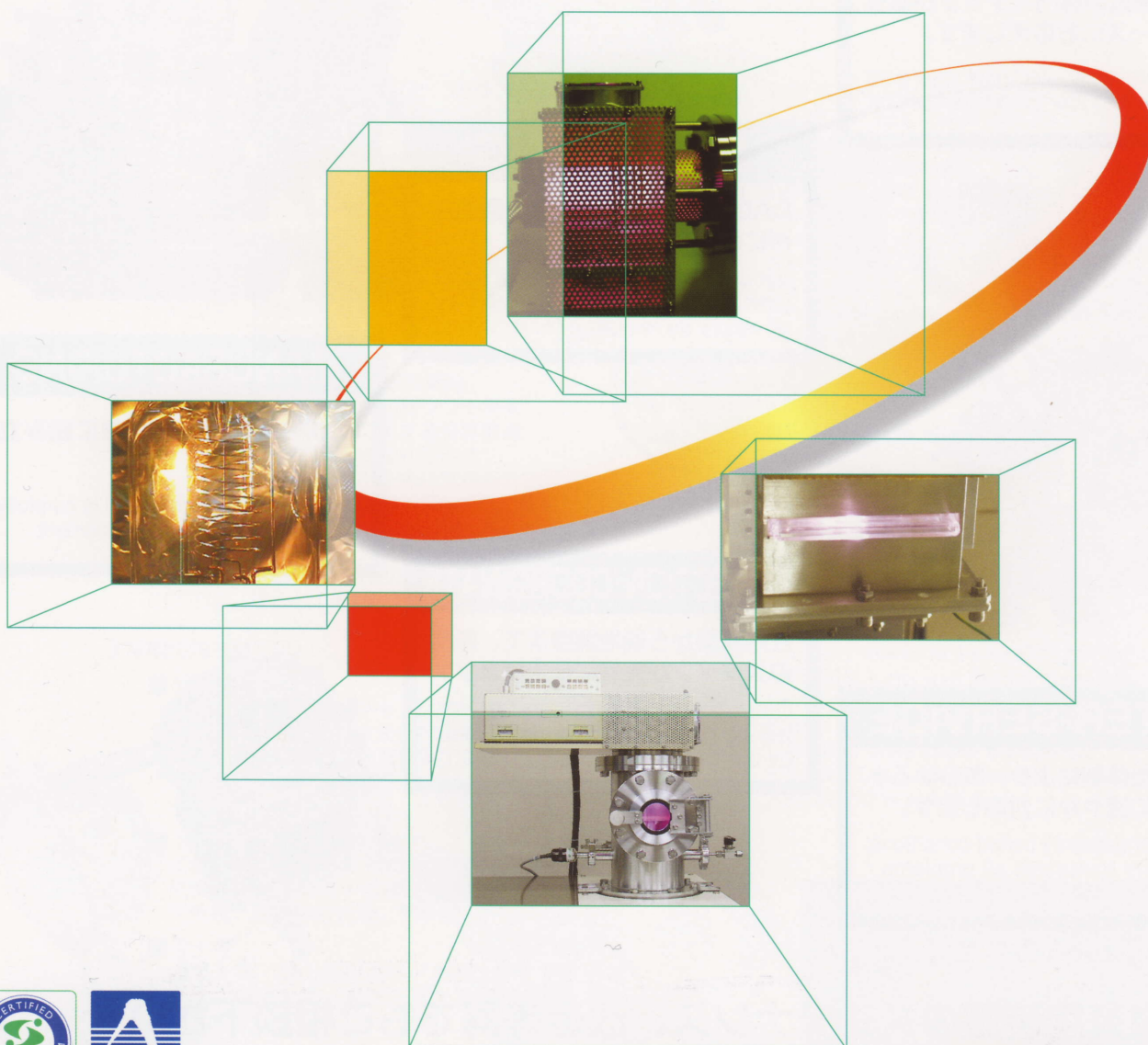
ARIOS



Corporate Profile

www.arios.jp

Vacuum & Plasma Equipment



ARIOS INC.
アリオス株式会社

当社は、1972年創業以来、真空機器、研究開発機器の設計製造販売を主体として発展してまいりました。

常に新しい技術への挑戦を続け、確かな実績を残してきたと自負しております。私達の仕事は、お客様のイメージを具体的な形にしていくこと、また、新しい技術を提案していくことと考え、今後も「超高真空技術、半導体技術を中心に先端技術分野において社会に貢献する」をモットーに努力してまいります。

これからも、一層のご指導お引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

Since our foundation in 1972 we have carried out our determination to continue the designing and manufacture of vacuum apparatus and have exerted further efforts into such research and development.

Our challenge is always aimed at new technology and this is our goal. The results achieved so far reflect this self-confidence of our purpose. Our work is to dedicate ourselves and realize in a concrete form the wishes of our customer's image. Moreover, when a new technology is proposed to us, it will be our motto from then on to do our very best succeed in that High-Tech field and contribute to this society focusing specifically on Ultra-High Vacuum Technology and Semi-Conductor Technology.

We solicit your guidance, backing and cooperation to achieve the best result.

Planning to After-Service

PLANNING

機械・電気の専門スタッフがあらゆるニーズにお応えします。

Our mechanical/ electrical engineers will respond to your every expectations.

DESIGNING

CAD を駆使しアイデアを最適な形にします。

Our designing team has a very high command of the latest CAD information and will embody any new idea in its optimal form.

MANUFACTURING

クリーンな環境で入念に組み立てます。

Our manufacturing division is carefully assembled in a clean environment.

INSPECTION/COORDINATE

社内調整から現地調整まで、専門のスタッフが完璧に仕上げます。

Dispatch of the finished goods will be organized and supervised by our competent staff.

AFTER-SERVICE

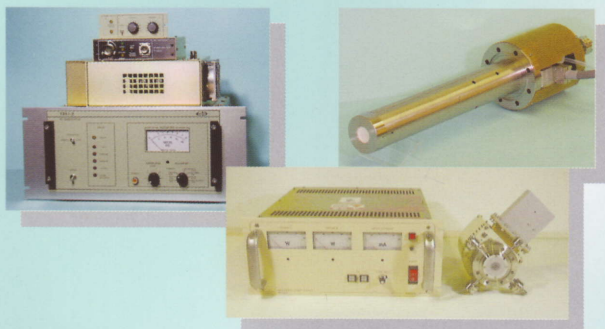
一貫した体制により、あらゆるトラブルに速やかに対応します。

Under our guaranty period conditions, we will try to resolve all problems / troubles promptly.

■真空装置のメンテナンス、改造等何でもご相談下さい

特に、装置排気系改造、手動装置の自動化等に多くの実績があります
国内メーカー、海外メーカーのほとんどに対応可能です

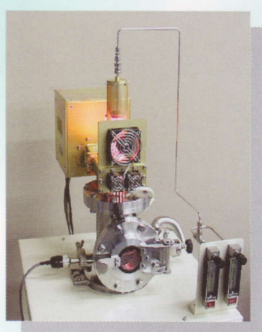
プラズマ製品 / Plasma Unit / Apparatus



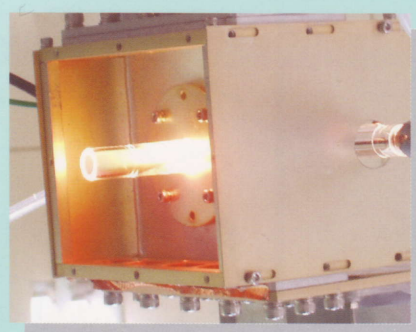
プラズマ源(マイクロ波・RF) / Plasma Source / (Microwave, RF)



ラングミュアプローブユニット / Langmuir Probe Unit



プラズマ実験装置 / Plasma Experimental System

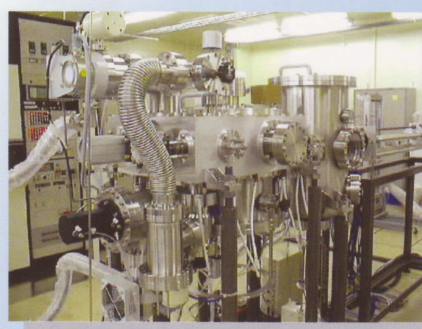


大気圧プラズマ源 / Atmospheric Plasma Source

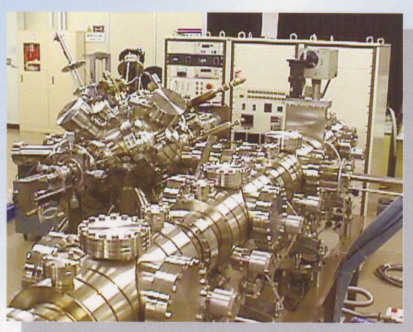
システム、装置 / Vacuum System, Apparatus



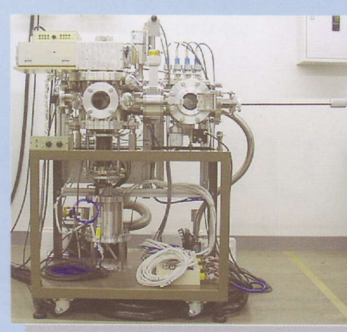
超高真空小型排気装置 / UHV Exhaust System



強誘電体成膜用MO-CVD装置 / MO-CVD System

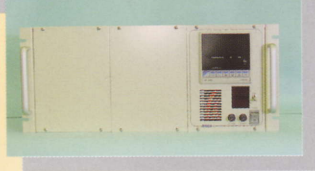


各種MBE装置 / MBE System

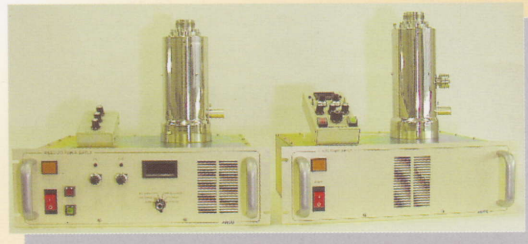


プラズマCVD装置 / Plasma CVD System

MBE関連ユニット / MBE Units



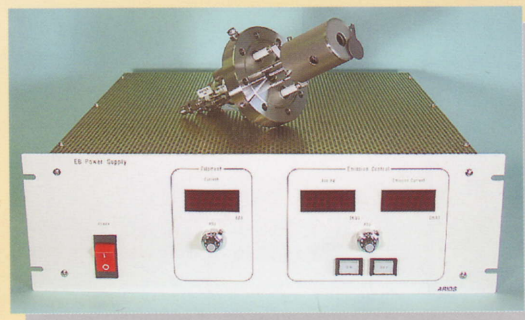
各種分子線セル、700W加熱電源/K-Cell, Power Supply



R-HEEDシステム / R-HEED System

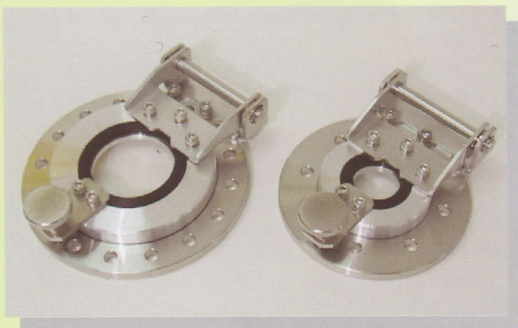


ビームフラックスモニター / Beam Flux Monitor



EB蒸着源ユニット / Miniature Evaporation Unit

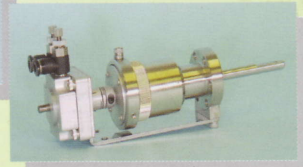
真空コンポーネンツ / Components



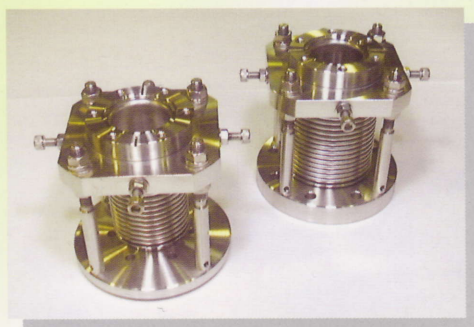
ロードロックハッチ / Load Lock-Door



回転導入機 / Rotary Motion



異径キューブ / Cube



簡易型XY機構 / Compact XY Stage



VPシャッター / VP Shutter

商号 アリオス株式会社

NAME ARIOS INC.

代表取締役 / 工学博士

PRESIDENT Dr. OSAMU ARIYADA

ありやだ
有屋田 修

設立 1972年8月

ESTABLISHED JULY, 1972

資本金 1500万円

CAPITAL ¥15,000,000

所在地 〒196-0021

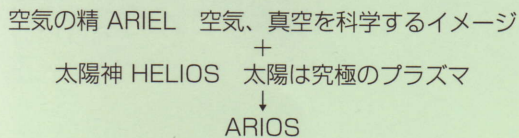
ADDRESS

東京都昭島市武蔵野3-2-20
TEL 042-546-4811
FAX 042-546-4814
http://www.arios.co.jp/

2-20, MUSASHINO 3CHOME, AKISHIMA,
TOKYO 196-0021 JAPAN
URL http://www.arios.co.jp/

当社は、空気の研究を支援するところから始まり、現在は、真空技術をベースにプラズマやイオンなどを利用した高度な技術に挑戦しています。
ARIOSは、そのことを表わしています。

In few years ago, our staff named company logo Arios. ARIOS was made from Ariel (a prankish spirit in shakespeare's The Tempest. Spirit of air) and Helios (the god of sun in Greek mythology. The sun is ultimate plasma). Our work was started to support the study of atmosphere, and now, is challenging high technology by plasma and ion etc. Arios shows this concept.



沿革

- 1972年 研究用機器の設計、製造、販売を主体として大誠産業株式会社を東京都調布市に設立
- 1980年 水素メーザー原子周波数標準器量子系開発
- 1985年 MBE装置関連事業開始
- 1988年 昭島市中神町に工場新設
- 1990年 超高真空スパッタ装置開発
- 1991年 資本金1500万円に増資
- 1993年 昭島市武蔵野に本社、工場を移転統合 RFラジカル源、R-HEEDシステム開発
マイクロ波イオン、ラジカル源開発
- 1994年 CVD装置関連事業開始
- 1997年 R-HEED画像処理ソフト開発
- 2000年 電離真空計に関する特許取得
- 2001年 アリオス株式会社に改名
東京都の中小企業経営革新計画承認
- 2002年 昭島市武蔵野3-2-20に移転し、フロア拡大
- 2003年 大気圧プラズマ源の開発
- 2004年 ISO14001認証取得
- 2005年 子会社(有)スプリード設立

HISTORY

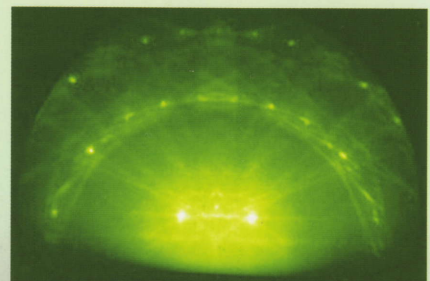
- 1972 1972 TAISEI INDUSTRY was established to CHOFU city, Tokyo also for the purpose of the designing apparatus for research, manufacture and sale.
- 1980 Development of the Hydrogen Maser
- 1985 The starting of MBE associated business.
- 1988 Its factory is newly established in NAKAGAMI-CHO, AKISHIMA city
- 1990 UHV sputter system is developed
- 1991 Increase of its capital to 15,000,000 Yen.
- 1993 The head office and a factory are moved together to MUSASHINO, AKISHIMA-city. RF radical source, R-HEED system are developed.
- 1994 Development of Microwave ion, radical source.
- 1995 Starting of CVD associated business.
- 1997 R-HEED Image-Processing Software is developed.
- 2000 Patent acquisition of ION GAUGE
- 2001 Recognition of the enterprises management plan of Tokyo is received.
Company name is changed to ARIOS INC.
- 2002 Company moves to 3-2-20 MUSASHINO, AKISHIMA city and floor is expanded.
- 2003 Development of the source of Atmospheric Plasma
- 2004 ISO 14001 certification is acquired.
- 2005 SPLEAD Ltd, a wholly-owned subsidiary of ARIOS INC is established.

主な取引先 (順不同)

- 企業
キヤノン株式会社 / キヤノンアネルバ株式会社 / シャープ株式会社 / 株式会社島津製作所 / 住友重機械工業株式会社 / 住友電気工業株式会社 / 日本電気株式会社 / 日本電子株式会社 / 株式会社リョーサン / 他多数
- 官公庁
気象研究所 / 産業技術総合研究所 / 情報通信研究機構 / 超先端電子技術開発機構 / 物質・材料研究機構 / 理化学研究所 / 他多数
- 大学
大阪大学 / 岡山理科大学 / 京都大学 / 電気通信大学 / 東京大学 / 東京工業大学 / 同志社大学 / 東北大学 / 北海道大学 / 室蘭工業大学 / 他多数

取引銀行

東京三菱銀行立川支社・昭島支店 / りそな銀行昭島支店 / 商工組合中央金庫八王子支店 / 西武信用金庫



● RHEEDパターン像

ARIOS



[交通機関] 「電車」JR青梅線、中神駅北口下車徒歩15分／西武拝島線、西武立川駅下車徒歩約20分
『自動車』中央自動車道、八王子インターより拝島橋経由、約20分
(by Train) JR Ome Line Nakagami station north entrance alighting on foot 15 minutes.
(by Car) It is about 20 minutes via the Hajima bridge from the Chuo Expressway Hachioji interchange.

ARIOS INC.

アリオス株式会社

2-20, MUSASHINO 3CHOME, AKISHIMA,
TOKYO 196-0021 JAPAN
TEL : 042-546-4811 FAX : 042-546-4814
〒196-0021 東京都昭島市武蔵野3-2-20
<http://www.arios.co.jp/>

